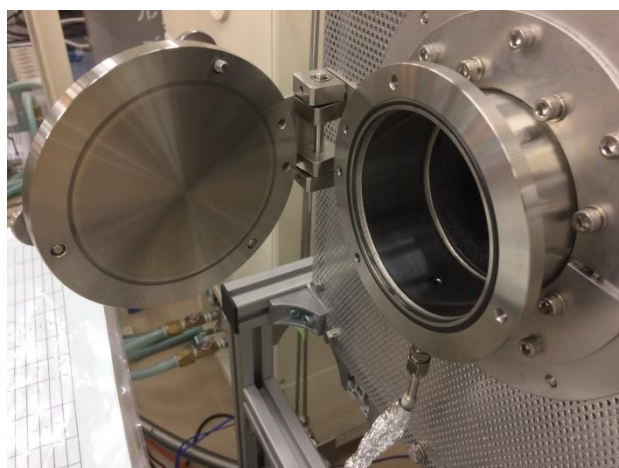


RF 炉使用方法

冷却ファンの電源を入れる



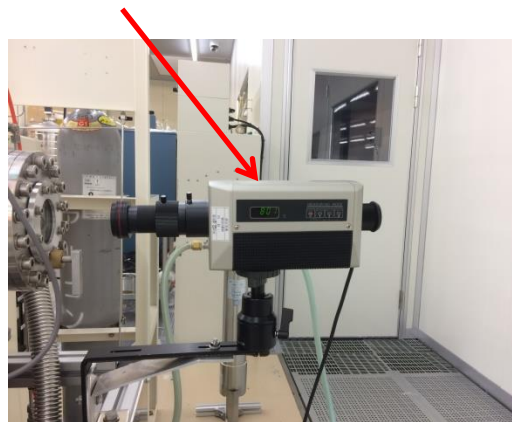
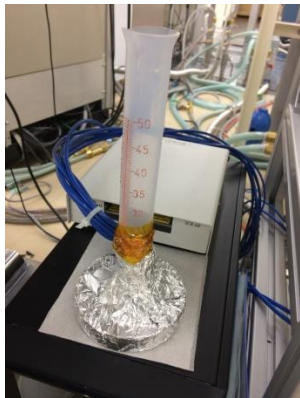
ベムコットできれいにゴムパッキンの周りと入り口部分をきれいに拭く



サセプタの窪みの上流側に試料を載せる。



サセプタが水平になるようにパイロメータで調整しながらストッパーで押し込む。



RV(ロータリーボルト)を限界まで開け少し戻す。

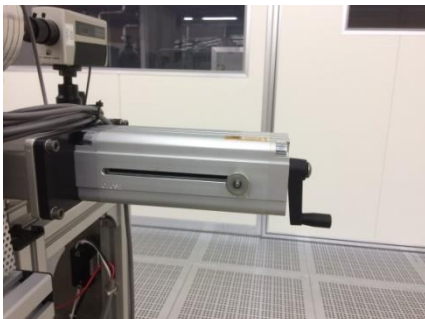
真空ポンプが 5.0×10^0 になるまで待つ。



RV(ロータリーボルト)を閉める。

MV(メインボルト)を素早く限界まで開け少し戻す。

ゲートバルブを限界まで開け少し戻す



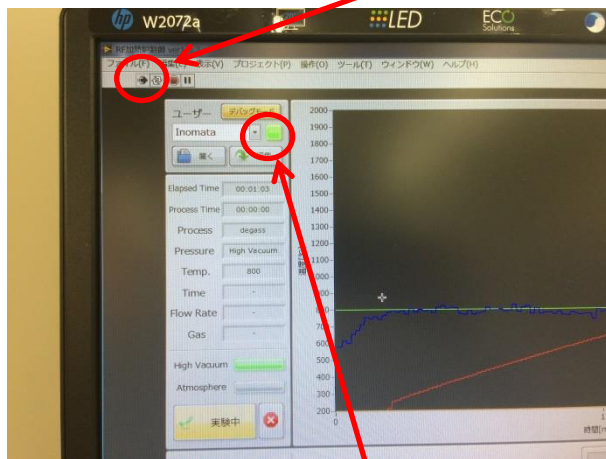
電源を入れる



真空ポンプが 10^{-4} になるまで待つ

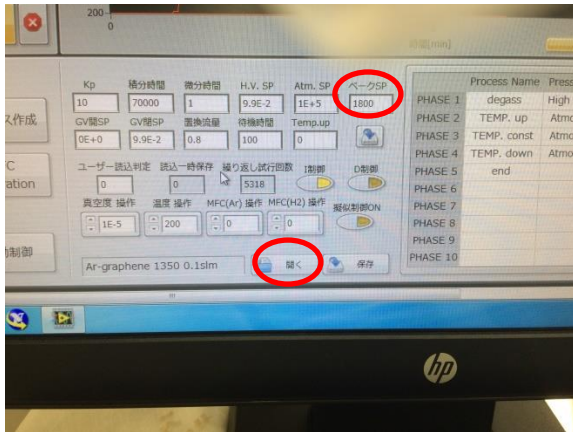
パソコンの電源を入れる． suemitsu833

「RF 加熱炉制御」フォルダを開き RF 加熱炉制御 ver1.0.7.vi を起動
LabVIEW を起動し，実行をクリック



INOMATA で開くを押すとグリーンなる．

画面下の開くをクリックし目的のファイルを選択する
Ar-graphene 1350 0.1slm



デバックモードをクリックしベーク SP が 1800 になっているか確認

冷却水を流す(図は流れている状態). メーターで水が流れていることを確認する.



ブースターポンプの電源を入れる



ブレーカの電源を入れ、緑のランプが点灯したら左から順に緑のボタンを押す
(H-READY→HEAT)



記録用紙に冷却水量までの条件を記入

実験開始をクリック

ゲートバルブを閉めて下さいと表示された degas 後の真空度を記録用紙に記入し、ゲートバルブを閉める.

電源を切る(点滅状態になる)

MV を閉める

1号炉側の Ar ガスを流す. 元栓を少し開ける. バルブを上から順に開ける. (メーターは右が1次, 左が2次側) 2次側の圧力を記録用紙に記入



CLOSE から CONT にスイッチを切り替える.

Ar 側のバルブをゆっくりメーターを見ながら回す. 速く回しすぎると試料が吹き飛ぶ.



「ゲートバルブを閉めてから「OK」を押してください。」の表示を OK を押して消す

温度が上昇していくときの電流の値を記録用紙に記入する.

温度が定常状態になった時の電圧と電流を記録用紙に記入する.

プログラムが終了したらブレーカの電源を切る. 赤いボタンを右から HEAT→H-READY
→ブレーカーの順番(電圧が 0 になったことを確認してからブレーカーを落とす)



800℃まで温度が下がるのを待つ. 記録用紙に時刻を記入する.

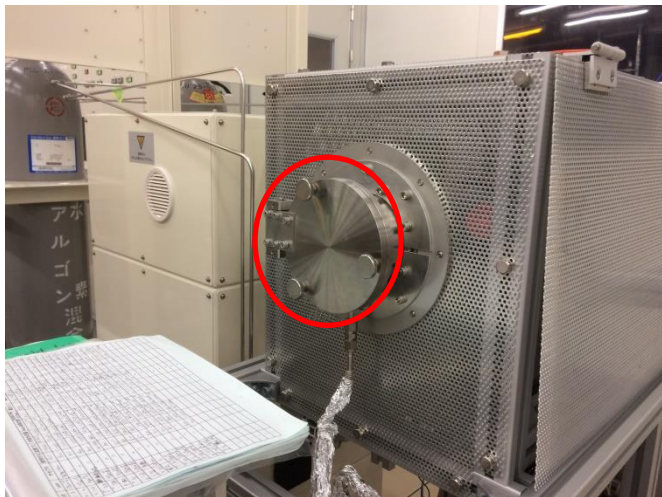
1 次側の圧力を記録用紙に記入したら CONT から CLOSE にスイッチを切り替え左にあるバルブを閉め, さらにボンベのバルブを閉め Ar ガスを止める.

ブースターポンプの電源を落とす.

冷却水を止める。メーターで流れていないことを確認する。

LabVIEW を終了させパソコンの電源を切る。

試料を入れる入口のねじを緩めておく



試料は終了後 2 時間以降に取り出す。

最後に冷却ファンの電源を切る。

* 試料を取り出す際に扉が開かない場合

Ar ガスをボンベから流し、赤丸の部分のバルブをゆっくり開け常圧まで戻す。

